



AMF 60 –

Modulares Gasreinigungssystem für
3D-Druckprozesse unter Inertgas

AMF 60

Die Geräte der AMF-Serie zeichnen sich durch eine hohe Abscheideleistung aus. Gesundheitsschädliche und qualitätsmindernde Partikel werden effizient aus der Prozessluft gefiltert, wodurch diese wieder verwendet werden kann.

Anwendungsvorteile

- Effizientes Energiemanagement durch automatische Volumenstromanpassung
- Prozess- und bediensicher
- Höchste Filtrationsleistung durch HEPA-H14-Filter
- Mobil und flexibel
- Global einsetzbar durch UL-Konformität und Spannungsweitbereich

Systemvorteile

- Kompaktes, gasdichtes und leistungsstarkes System zur Prozessgasreinigung
- Einsatzfähig für jegliche Inertgase
- Passivierbare Speicherfilter
- Frontseitiger Wechsel gesättigter Filterzellen
- Kontaminationsfreie Speicherung leicht entzündlicher und gesundheitsschädlicher Prozessschadstoffe
- Integrierbar als Slave mit I/O-System oder Stand-alone mit CULT™-Steuerung
- Skalierbar

Sie haben Anpassungswünsche?
Kontaktieren Sie uns:



Technische Ausstattung

Max. Volumenstrom in m ³ /h	90
Max. Unterdruck in Pa	17.500
Nennleistung in m ³ /h@Pa	60 @ 10.000
Spannungsweitbereich	90~250 VAC
Anschlussleistung in kW	0,65
Frequenz	50/60 Hz
Abmessungen in mm (B x T x H)	450 x 644 x 760
Vor- und Nachfilter	HEPA H14
Gesamtabscheidegrad	< 99,995 %
Gewicht in kg	85
Anschlussvariante (Roh- und Reingas)	DN 40

- Sensorische Überwachung relevanter Prozessparameter
- Zeitsteuerung und Data Log Funktion
- Absperrvorrichtung des Vorfilters

